(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 219212737 U
(45)授权公告日 2023.06.20

(21)申请号 202222756451.0

(22)申请日 2022.10.18

(73)专利权人 重庆善工幕墙材料有限公司
地址 400000 重庆市大足区龙水镇工业园区(龙水路613号)

(72)发明人 李昭 可荣荣 谢桂林

(51)Int.Cl.
B24B 29/06(2006.01)
B24B 27/00(2006.01)
B24B 41/00(2006.01)

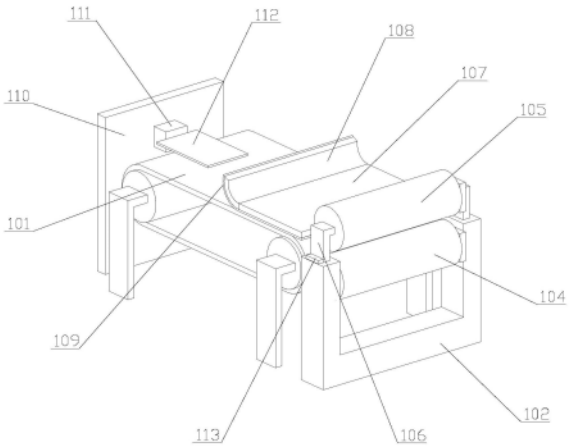
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种抛光设备

(57)摘要

本实用新型涉及铝单板加工设备技术领域，具体涉及一种抛光设备；包括传送带、支撑架、第一抛辊、第二抛辊和调节模块，调节模块包括调节架、调节板、引导弧板、光滑片和推动组件，调节架与支撑架滑动连接，调节架上设置有第二抛辊，调节板与调节架固定连接，引导弧板与调节板固定连接，光滑片分别与引导弧板和调节板固定连接，通过铝单板在传送带移动，在引导弧板的引导下，铝单板位于调节板的下方，调节板根据铝单板的厚度改变调节架的高度，此时第一抛辊和第二抛辊之间的距离与铝单板的厚度相同，获得调节第一抛辊与第二抛辊之间距离，可适用于厚度不同的铝单板进行双面抛光处理的效果。



CN 219212737 U

1.一种抛光设备,包括传送带、支撑架、第一抛辊和第二抛辊,所述支撑架设置于所述传送带的一侧,所述支撑架上设置有所述第一抛辊,所述第二抛辊设置于所述第一抛辊的上方,其特征在于,

还包括调节模块,所述调节模块包括调节架、调节板、引导弧板、光滑片和推动组件,所述支撑架具有滑动槽,所述调节架与所述支撑架滑动连接,并位于所述滑动槽内,所述调节架上设置有所述第二抛辊,所述调节板与所述调节架固定连接,并位于所述传送带的上方,所述引导弧板与所述调节板固定连接,所述光滑片分别与所述引导弧板和所述调节板固定连接,所述推动组件设置于所述传送带的上方;

所述调节模块还包括限位块,所述限位块与所述调节架固定连接,并位于所述支撑架的上方;

所述调节模块还包括导轨和滑块,所述导轨与所述支撑架固定连接,并位于所述滑动槽内,所述滑块与所述调节架固定连接,并滑动设置于所述导轨内;

所述调节模块还包括弹簧,所述弹簧的两端分别与所述导轨和所述滑块固定连接。

2.如权利要求1所述的抛光设备,其特征在于,

所述调节模块还包括限位块,所述限位块与所述调节架固定连接,并位于所述支撑架的上方。

3.如权利要求1所述的抛光设备,其特征在于,

所述推动组件包括连接架、气缸和推动板,所述气缸与所述连接架固定连接,所述推动板与所述气缸的输出端固定连接,并位于所述传送带的上方。

一种抛光设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及铝单板加工设备技术领域，尤其涉及一种抛光设备。

背景技术

[0002] 目前在铝单板抛光过程中，需要在铝单板的一面进行抛光后，将铝单板翻面，再对铝单板的另一面进行抛光，抛光效率低。

[0003] 现有技术中CN210099704U公开了一种铝单板生产用自动抛光设备，使用第一抛辊和第二抛辊同时对铝单板的双面进行抛光处理，以此提高抛光效率。

[0004] 在第一抛辊和第二抛辊对铝单板进行抛光处理的过程中，第一抛辊和第二抛辊之间距离固定，不适用于厚度不同的铝单板进行双面抛光处理。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种抛光设备，解决了第一抛辊和第二抛辊之间距离固定，不适用于厚度不同的铝单板进行双面抛光处理的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型采用的一种抛光设备，包括传送带、支撑架、第一抛辊、第二抛辊和调节模块，所述支撑架设置于所述传送带的一侧，所述支撑架上设置有所述第一抛辊，所述第二抛辊设置于所述第一抛辊的上方；

[0007] 所述调节模块包括调节架、调节板、引导弧板、光滑片和推动组件，所述支撑架具有滑动槽，所述调节架与所述支撑架滑动连接，并位于所述滑动槽内，所述调节架上设置有所述第二抛辊，所述调节板与所述调节架固定连接，并位于所述传送带的上方，所述引导弧板与所述调节板固定连接，所述光滑片分别与所述引导弧板和所述调节板固定连接，所述推动组件设置于所述传送带的上方。

[0008] 其中，所述调节模块还包括限位块，所述限位块与所述调节架固定连接，并位于所述支撑架的上方。

[0009] 其中，所述推动组件包括连接架、气缸和推动板，所述气缸与所述连接架固定连接，所述推动板与所述气缸的输出端固定连接，并位于所述传送带的上方。

[0010] 其中，所述调节模块还包括导轨和滑块，所述导轨与所述支撑架固定连接，并位于所述滑动槽内，所述滑块与所述调节架固定连接，并滑动设置于所述导轨内。

[0011] 其中，所述调节模块还包括弹簧，所述弹簧的两端分别与所述导轨和所述滑块固定连接。

[0012] 本实用新型的一种抛光设备，铝单板在所述传送带移动，在所述引导弧板的引导下，铝单板位于所述调节板的下方，所述调节板根据铝单板的厚度改变所述调节架的高度，此时所述第一抛辊和所述第二抛辊之间的距离与铝单板的厚度相同，获得调节所述第一抛辊与所述第二抛辊之间距离，可适用于厚度不同的铝单板进行双面抛光处理的效果。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0014] 图1是本实用新型第一实施例的整体的结构示意图。

[0015] 图2是本实用新型第一实施例的整体的结构正视图。

[0016] 图3是本实用新型第一实施例的支撑架的结构剖视图。

[0017] 图4是本实用新型第二实施例的支撑架的结构示意图。

[0018] 101-传送带、102-支撑架、103-滑动槽、104-第一抛辊、105-第二抛辊、106-调节架、107-调节板、108-引导弧板、109-光滑片、110-连接架、111-气缸、112-推动板、113-限位块、201-导轨、202-滑块、203-弹簧。

具体实施方式

[0019] 下面详细描述本实用新型的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。

[0020] 第一实施例

[0021] 请参阅图1～图3，其中图1是第一实施例的整体的结构示意图，图2是第一实施例的整体的结构正视图，图3是第一实施例的支撑架的结构剖视图。

[0022] 本实用新型提供一种抛光设备：包括传送带101、支撑架102、第一抛辊104、第二抛辊105和调节模块，所述调节模块包括调节架106、调节板107、引导弧板108、光滑片109、推动组件和限位块113，所述推动组件包括连接架110、气缸111和推动板112。通过前述方案解决了所述第一抛辊104和所述第二抛辊105之间距离固定，不适用于厚度不同的铝单板进行双面抛光处理，可以理解的是，前述方案可以在对金属板抛光的场景，还可以用于金属板抛光效率低的问题的解决上。

[0023] 针对本具体实施方式，所述支撑架102设置于所述传送带101的一侧，所述支撑架102上设置有所述第一抛辊104，所述第二抛辊105设置于所述第一抛辊104的上方，使用所述第一抛辊104和所述第二抛辊105同时对铝单板的双面进行抛光处理，以此提高铝单板抛光效率。

[0024] 其中，所述调节模块包括调节架106、调节板107、引导弧板108、光滑片109和推动组件，所述支撑架102具有滑动槽103，所述调节架106与所述支撑架102滑动连接，并位于所述滑动槽103内，所述调节架106上设置有所述第二抛辊105，所述调节板107与所述调节架106固定连接，并位于所述传送带101的上方，所述引导弧板108与所述调节板107固定连接，所述光滑片109分别与所述引导弧板108和所述调节板107固定连接，所述推动组件设置于所述传送带101的上方，铝单板在所述传送带101移动，在所述引导弧板108的引导下，铝单板位于所述调节板107的下方，所述调节板107根据铝单板的厚度改变所述调节架106的高度，此时所述第一抛辊104和所述第二抛辊105之间的距离与铝单板的厚度相同，获得调节

所述第一抛辊104与所述第二抛辊105之间距离，可适用于厚度不同的铝单板进行双面抛光处理的效果。

[0025] 其次，所述限位块113与所述调节架106固定连接，并位于所述支撑架102的上方，所述限位块113限制所述调节架106与所述支撑架102之间的最小距离，避免所述调节板107与所述传送带101之间的距离过小，影响铝单板在所述传送带101上传输效率。

[0026] 同时，所述气缸111与所述连接架110固定连接，所述推动板112与所述气缸111的输出端固定连接，并位于所述传送带101的上方，将铝单板放置于所述传送带101上，所述气缸111运作，驱动所述推动板112移动，带动铝单板移动。

[0027] 在使用本实用新型将铝单板进行抛光时，将铝单板放置于所述传送带101上，所述气缸111运作，驱动所述推动板112移动，带动铝单板移动，在所述引导弧板108的弧面的引导下，铝单板被所述调节板107压制于所述调节板107的下方，铝单板与所述光滑片109接触，减小铝单板受到的摩擦，所述调节板107根据铝单板的厚度改变所述调节架106的高度，所述调节架106在所述滑动槽103内滑动，此时所述第一抛辊104和所述第二抛辊105之间的距离与铝单板的厚度相同，获得调节所述第一抛辊104与所述第二抛辊105之间距离，可适用于厚度不同的铝单板进行双面抛光处理的效果，所述限位块113限制所述调节架106与所述支撑架102之间的最小距离，避免所述调节板107与所述传送带101之间的距离过小，影响铝单板在所述传送带101上传输效率。

[0028] 第二实施例

[0029] 请参阅图4，其中图4是第二实施例的支撑架的结构示意图。

[0030] 在第一实施例的基础上，本实用新型的一种抛光设备包括调节模块，所述调节模块还包括导轨201、滑块202和弹簧203。

[0031] 所述导轨201与所述支撑架102固定连接，并位于所述滑动槽103内，所述滑块202与所述调节架106固定连接，并滑动设置于所述导轨201内，所述调节架106在所述滑动槽103内滑动的过程中，所述滑块202在所述导轨201内滑动，以便提高所述调节架106移动中的稳定性。

[0032] 所述弹簧203的两端分别与所述导轨201和所述滑块202固定连接，所述弹簧203起到缓冲效果。

[0033] 所述调节架106在所述滑动槽103内滑动的过程中，所述滑块202在所述导轨201内滑动，以便提高所述调节架106移动中的稳定性，所述弹簧203起到缓冲效果。

[0034] 以上所揭露的仅为本实用新型一种较佳实施例而已，当然不能以此来限定本实用新型之权利范围，本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程，并依本实用新型权利要求所作的等同变化，仍属于实用新型所涵盖的范围。

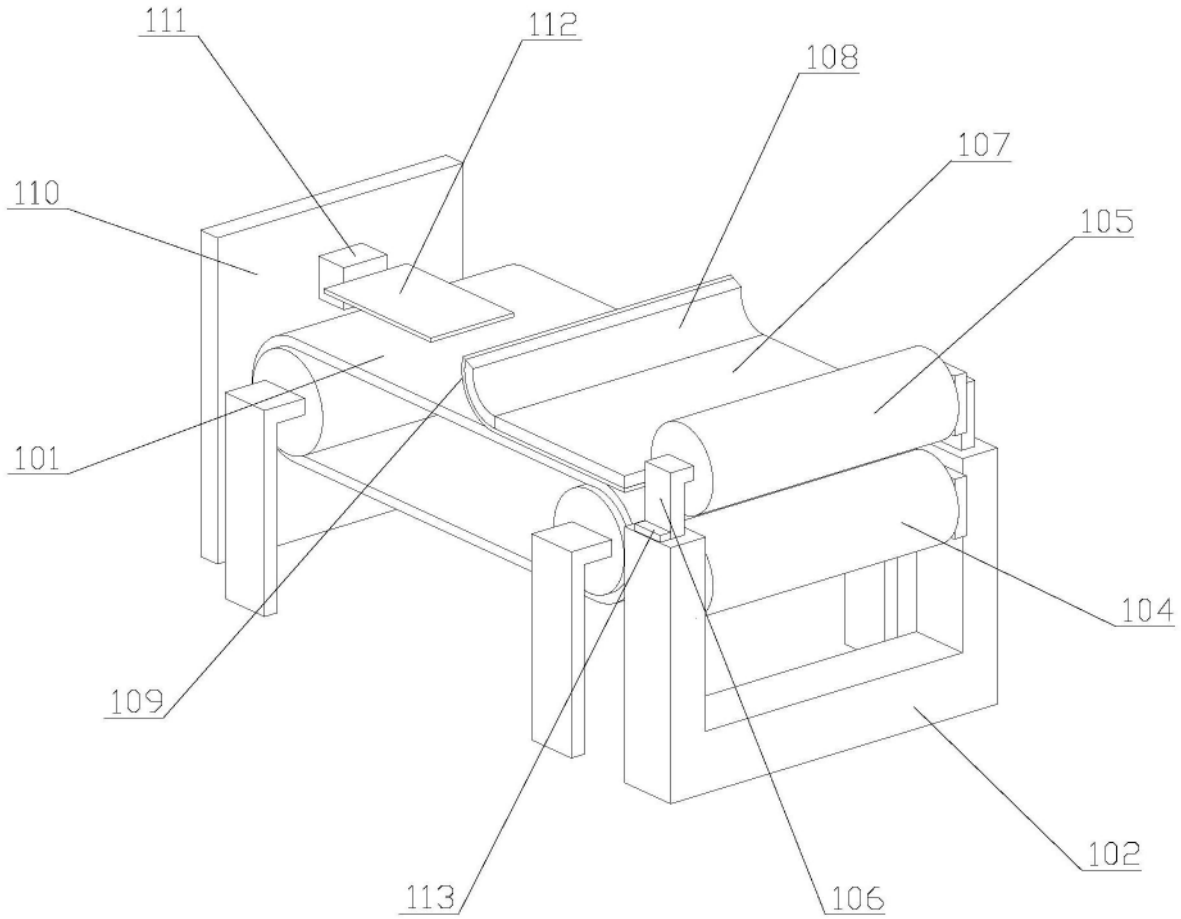

111
112
108
107
110
105
101
104
109
102
113
106

图1

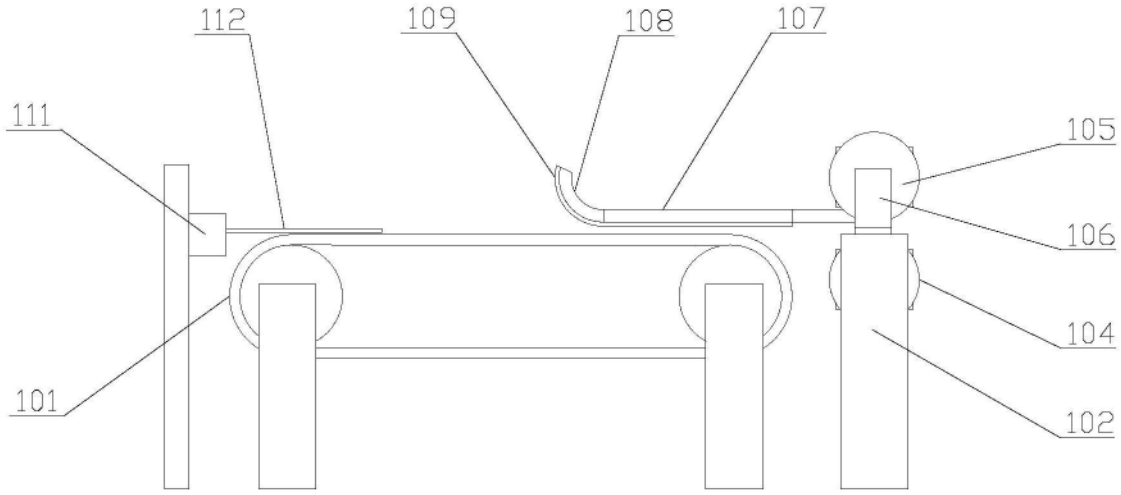

112
109
108
107
111
105
106
104
101
102

图2

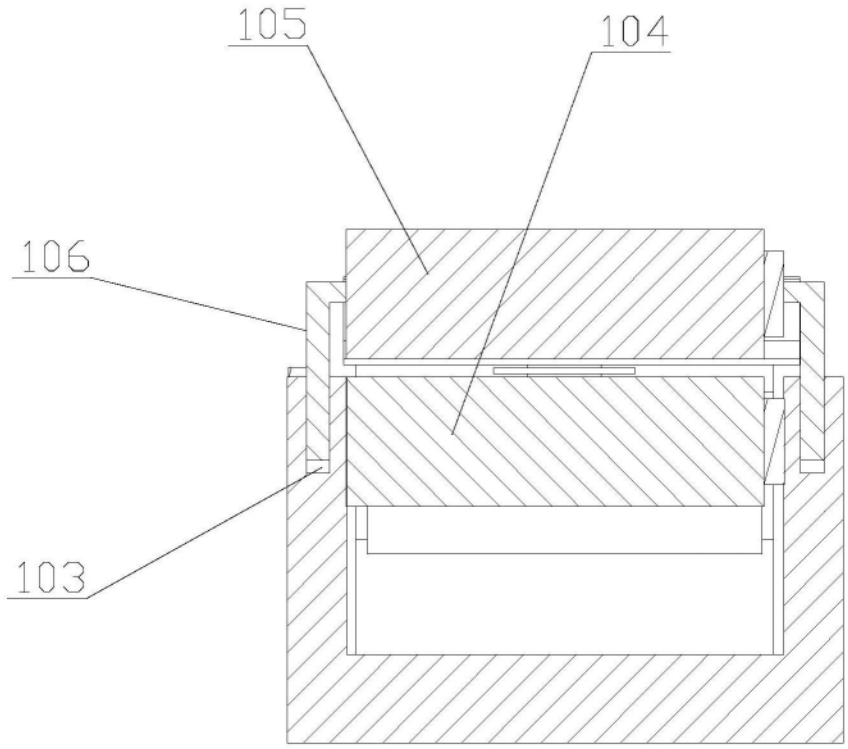


图3

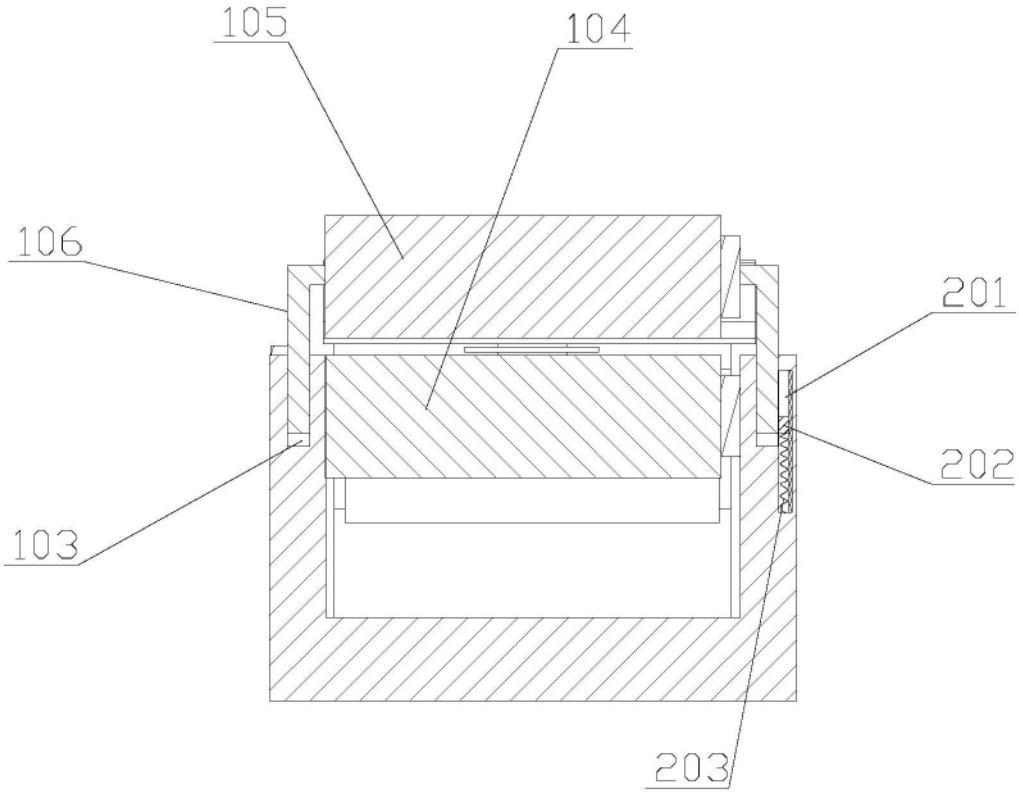


图4